



## 一种用于薄壁平面工件固定的真空吸附装置

文献类型: 专利

**作者** 张华民; 马海鹏; 刘波

**发表日期** 2011-09-14

**专利国别** 中文

**专利号** CN201020634435.9

**专利类型** 实用新型

**关键词** 物理化学

**权利人** 中国科学院大连化学物理研究所

**是否PCT专利** 待填写

**中文摘要** 本实用新型公开了一种用于薄壁平面工件固定的真空吸附装置,包括真空吸附板和密封盖板。真空吸附板的上表面设有贯穿真空吸附板的n个吸气孔,下表面开设有m条互不连通的真空凹槽,每条真空凹槽既与若干吸气孔相连通,也与抽真空系统的吸气管相连通。每条真空凹槽周边均开设有互不连通的环绕真空凹槽的环形密封槽,内置密封材料,与密封盖板一起,将真空吸附板的上表面形成了m个互不连通的真空吸附区域。结合吸气孔孔塞的使用,可以解决真空吸附装置工作过程中个别吸气孔出现突发密封问题所导致工件吸附失效问题;工件本体具有贯穿孔的真空吸附问题及在真空吸附固定方式下,工件内部的切割操作等问题。

**学科主题** 物理化学

**公开日期** 2011-09-14

**申请日期** 2010-11-30

**语种** 中文

**资助信息** 中国科学院大连化学物理研究所; 辽宁石油化工大学

**专利证书号** 待填写

**专利申请号** CN201020634435.9

**专利代理** 马驰

**源URL** [http://159.226.238.44/handle/321008/116191]

**专题** 大连化学物理研究所\_中国科学院大连化学物理研究所

**推荐引用方式** 张华民,马海鹏,刘波. 一种用于薄壁平面工件固定的真空吸附装置,一种用于薄壁平面工件固定的真空吸附装置.

**GB/T 7714** CN201020634435.9. 2011-09-14.

入库方式: OAI收割

来源: 大连化学物理研究所

浏览	下载	收藏
556	0	0

### 其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

